

Biuletyn Informacji Publicznej

Adres artykułu: <https://bip.tu.kielce.pl/artykul/konkurs-na-stanowisko-asystenta-grupie-pracownikow-dydaktycznych-w-dyscyplinie-inzynieria-mechaniczna-2-stanowiska>

konkurs na stanowisko asystenta grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna - 2 stanowiska

INSTYTUCJA: **Politechnika Świętokrzyska**

MIASTO: **Kielce**

STANOWISKO: **asystent w grupie pracowników dydaktycznych - 2 stanowiska**

DYSCYPLINA NAUKOWA: **inżynieria mechaniczna**

SPECJALNOŚĆ: **automatyka i robotyka**

DATA OGŁOSZENIA: **01.08.2024 r.**

TERMIN SKŁADANIA OFERT: **19.09.2024 r.**

LINK DO STRONY: <https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/>

SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

OPIS: kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

- dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka,
- sprecyzowany indywidualny plan badawczy zawierający harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej zaaprobowany przez pracownika naukowego ze stopniem doktora hab. lub tytułem profesora,
- znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC,
- programowanie mikrokontrolerów z serii AVR, STM32, ESP32
- umiejętność projektowania układów elektrycznych i elektronicznych w tym obwodów w PCB,
- umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, C# programów dla systemów Windows,
- umiejętności obsługi programów stosowanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Matlab-Simulink, EPLAN, Mathcad

- znajomość obsługi urządzeń pomiarowych w tym oscyloskopów, kart pomiarowych, przetworników i czujników,
- biegła znajomość języka polskiego,
- znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2),
- zamiłowanie do pracy dydaktycznej.

Dodatkowe atuty:

- doświadczenie w pracy w przemyśle,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- publikacje w czasopiśmie znajdujących się na liście czasopism punktowanych,
- prowadzenie badań naukowych związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów,
- działalność promocyjna na rzecz uczelni.

Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
- życiorys (CV), kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz opis indywidualnego planu badawczego,
- informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;
- oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

**Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10
bud. B**

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia **19.09.2024 r.** Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

[Informacja o wyniku konkursu](#)

Załączniki:

[Informacja o wyniku konkursu](#) pdf, 120 kB

Wytworzył:	dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk
Data wytworzenia:	14.10.2024
Opublikował w BIP:	Ewa Karońska
Data opublikowania:	14.10.2024 14:13
Liczba pobrań:	7

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PŚk
Data wytworzenia:	01.08.2024
Opublikował w BIP:	Miłosz PINDUR
Data opublikowania:	01.08.2024 08:08
Ostatnio zaktualizował:	Ewa Karońska
Data ostatniej aktualizacji:	25.10.2024 07:30
Liczba wyświetleń:	31